⑶　入札者に要求される事項　この一般競争に参加を希望する者は、封印した入札書に本公告に示した物品を納入できることを証明する書類を添付して入札書の受領期限までに提出しなければならない。入札者は、開札日の前日までの間において、契約担当役から当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
⑷　入札の無効　本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書、その他入札説明書による。
⑸　契約書作成の要否　要。
⑹　落札者の決定方法　本公告に示した物品を納入できると契約担当役が判断した入札者であって、国立大学法人東京工業大学の契約事務取扱細則第13条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。
⑺　手続における交渉の有無　無。
⑻　その他　詳細は、入札説明書による。

5　Summary
⑴　Official in charge of disbursement of the procuring entity : Hiroyuki Tanzawa, The Obligating Officer Administration Bureau, Tokyo Institute of Technology
⑵　Classification of the products to be procured : 24
⑶　Nature and quantity of the products to be purchased : 5-axis CNC machine 1 Set
⑷　Delivery period : By 30 March, 2015
⑸　Delivery place : Graduate School of Science and Engineering (Technology) Tokyo Institute of Technology
⑹　Qualifications for participating in the tendering procedures : Suppliers eligible for participating in the proposed tender are those who shall :
A　not come under Article 10 and 11 of the Regulation concerning the Contract for Tokyo Institute of Technology,
B　have the Grade A, Grade B, Grade C or Grade D qualification during fiscal 2014 in the Kanto・Koshinetsu area in sales of product for participating in tenders by Single qualification for every ministry and agency,
C　prove to have prepared a system to provide rapid after-sale service and maintenance for the procured products,
D　meet the qualification requirements which The Obligating Officer may specify in accordance with Article 12 of the Regulation,
E　not be currently under a suspension of business order as instructed by The Obligating Officer.
⑺　Time limit of tender : 17 : 00　1 December, 2014
⑻　Contact point for the notice : Yushin Wada, Research Fund Management Division, Research Promotion Department, Tokyo Institute of Technology, 2―12―1 Ookayama, Meguro-ku, Tokyo 152―8550 Japan, TEL 03―5734―3753

入札公告

次のとおり一般競争入札に付します。
平成26年10月10日
契約担当役
国立大学法人東京工業大学
事務局長　丹沢　広行

◎調達機関番号　415　◎所在地番号　13

○第22号

1　調達内容
⑴　品目分類番号　24
⑵　購入等件名及び数量
A　超高温単結晶育成システム　一式
B　酸化膜用反応性イオンエッチング　一式
⑶　調達件名の特質等　入札説明書による。
⑷　納入期限　平成27年３月31日
⑸　納入場所　東京工業大学すずかけ台キャンパス
⑹　入札方法　上記１⑵の件名ごとにそれぞれ入札に付する。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の８パーセントに相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の108分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

2　競争参加資格
⑴　国立大学法人東京工業大学の契約事務取扱細則第10条及び第11条の規定に該当しない者であること。（代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても同様とする。）
⑵　入札者の競争参加資格　国の競争参加資格（全省庁統一資格）において平成26年度に関東・甲信越地域の「物品の販売」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。なお、当該競争参加資格については、平成26年３月28日付け号外政府調達第57号の官報の競争参加者の資格に関する公示の別表に掲げる申請受付窓口において随時受け付けている。
⑶　購入物品に係る迅速なアフターサービス・メンテナンスの体制が整備されていることを証明した者であること。
⑷　本公告に示した物品を契約担当役が指定する日時、場所に十分に納入することができることを証明した者であること。
⑸　国立大学法人東京工業大学の契約事務取扱細則第12条の規定に基づき、契約担当役が定める資格を有する者であること。
⑹　契約担当役から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。

3　入札書の提出場所等
⑴　入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問合せ先
〒226―8503　神奈川県横浜市緑区長津田町4259　東京工業大学すずかけ台地区事務部会計課外部資金執行グループ　平山　隆広　電話045―924―5917
⑵　入札説明書の交付方法　本公告の日から上記３⑴の交付場所にて交付する。
⑶　入札書の受領期限　上記１⑵の件名ごとに次のとおりとする。
A　平成26年12月１日12時00分
B　平成26年11月20日12時00分
⑷　開札の日時及び場所　上記１⑵の件名ごとに次のとおりとする。
A　平成26年12月12日14時00分　東京工業大学すずかけ台地区Ｊ２棟404号室
B　平成26年11月28日16時30分　東京工業大学すずかけ台地区Ｊ２棟404号室

4　その他
⑴　契約手続において使用する言語及び通貨　日本語及び日本国通貨。
⑵　入札保証金及び契約保証金　免除。
⑶　入札者に要求される事項　この一般競争に参加を希望する者は、封印した入札書に本公告に示した物品を納入できることを証明する書類を添付して入札書の受領期限までに提出しなければならない。入札者は、開札日の前日までの間において、契約担当役から当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
⑷　入札の無効　本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書、その他入札説明書による。
⑸　契約書作成の要否　要。
⑹　落札者の決定方法　本公告に示した物品を納入できると契約担当役が判断した入札者であって、国立大学法人東京工業大学の契約事務取扱細則第13条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した次順位者を落札者とする。
⑺　手続における交渉の有無　無。
⑻　その他　詳細は、入札説明書による。

5　Summary
⑴　Official in charge of disbursement of the procuring entity : Hiroyuki Tanzawa, The Obligating Officer Administration Bureau, Tokyo Institute of Technology
⑵　Classification of the products to be procured : 24
⑶　Nature and quantity of the products to be purchased :
A　Ultra-High Temperature Single-Crystal Growth System 1 Set
B　Reactive ion etching for oxides 1 Set